2026年度ナノプロセシング施設（NPF）単価表

2026年10月1日改訂

装置番号	装置名称	設置場所	装置分類	トレーニング料金	備考（注1）	利用報告書提出& データ提供			利用報告書提出			利用報告書非提出（注4） & データ提供			利用報告書非提出（注4）		
						機器利用	技術補助	技術代行（注3）	機器利用	技術補助	技術代行（注3）	機器利用	技術補助	技術代行（注3）	機器利用	技術補助	技術代行（注3）
						（円/時間）	（円/時間）	（円/時間）	（円/時間）	（円/時間）	（円/時間）	（円/時間）	（円/時間）	（円/時間）	（円/時間）	（円/時間）	（円/時間）
NPF003	イオンコーター（FIB付帯）（2F）	2F 一般実験室	観察・計測・分析	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF004	電界放出形走査電子顕微鏡[S4800_FE-SEM]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	6000	有償トレーニング	8,000	20,000	22,000	11,200	28,000	30,800	16,000	40,000	44,000	22,400	56,000	61,600
NPF006	マスクレス露光装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィー	5000	有償トレーニング	10,400	20,400	23,400	14,500	28,500	32,700	29,000	49,000	55,000	40,600	68,600	77,000
NPF008	スピンコーター（フォト）	CR2 イエロールーム	リソグラフィー	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF009	コンタクトマスクアライナー[MJB4]	CR2 イエロールーム	リソグラフィー	5000	有償トレーニング	2,600	12,600	15,600	3,600	17,600	21,800	6,400	26,400	32,400	8,900	36,900	45,300
NPF010	反転露光用全面UV照射装置	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー	4000	有償トレーニング	500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF011	i線露光装置	CR3 イエロールーム	リソグラフィー		技術代行専用	19,500	31,500	33,500	27,300	44,100	46,900	52,000	76,000	80,000	72,800	106,400	112,000
NPF012	有機ドラフトチャンバー_右（フォト）（注5）	CR2 イエロールーム	リソグラフィー	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF013	有機ドラフトチャンバー_左（フォト）（注5）	CR2 イエロールーム	リソグラフィー	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF014	有機ドラフトチャンバー_右（EB）（注6）	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF015	酸アルカリドラフトチャンバー_右	CR1 クリーンルーム	表面処理	0		500	12,500	14,500	500	12,500	14,500	6,200	30,200	34,200	7,700	30,200	34,200
NPF016	スターラーウォーターバス[SWB-10L-1]	CR1 クリーンルーム	表面処理	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF017	スマートウォーターバス[TB-1N]（フォト）	CR2 イエロールーム	リソグラフィー	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF018	反応性イオンエッチング装置（RIE）	CR5 クリーンルーム	エッチング	5000	有償トレーニング	4,000	14,000	17,000	5,600	19,600	23,800	10,400	30,400	36,400	14,500	42,500	50,900
NPF019	多目的エッチング装置（ICP-RIE）	CR5 クリーンルーム	エッチング	5000	有償トレーニング	10,400	20,400	23,400	14,500	28,500	32,700	29,000	49,000	55,000	40,600	68,600	77,000
NPF021	プラズマアッシャー	CR5 クリーンルーム	表面処理	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF022	UVオゾンクリーナー	CR5 クリーンルーム	表面処理	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF023	電子ビーム真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜	5000	有償トレーニング	9,000	19,000	22,000	12,600	26,600	30,800	19,000	39,000	45,000	26,600	54,600	63,000
NPF024	抵抗加熱型真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜	5000	有償トレーニング	5,000	15,000	18,000	7,000	21,000	25,200	10,000	30,000	36,000	14,000	42,000	50,400
NPF025	スパッタ成膜装置（芝浦）	CR1 クリーンルーム	成膜	5000	有償トレーニング	6,000	16,000	19,000	8,400	22,400	26,600	12,000	32,000	38,000	16,800	44,800	53,200
NPF029	メッキ装置	CR1 クリーンルーム	成膜	6000	有償トレーニング	2,600	14,600	16,600	3,600	20,400	23,200	8,000	32,000	36,000	11,200	44,800	50,400
NPF030	プラズマCVD薄膜堆積装置	CR5 クリーンルーム	成膜	5000	有償トレーニング	4,600	14,600	17,600	6,400	20,400	24,600	16,000	36,000	42,000	22,400	50,400	58,800
NPF031	原子層堆積装置_1[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜		技術代行専用	8,000	18,000	21,000	11,200	25,200	29,400	19,200	39,200	45,200	26,800	54,800	63,200
NPF032	クロスセクションポリッシャ（ALD付帯）	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	5000	有償トレーニング	4,000	14,000	17,000	5,600	19,600	23,800	9,600	29,600	35,600	13,400	41,400	49,800
NPF033	アルゴンミリング装置	CR1 クリーンルーム	エッチング	5000	有償トレーニング	4,000	14,000	17,000	5,600	19,600	23,800	9,600	29,600	35,600	13,400	41,400	49,800
NPF034	集束イオンビーム加工観察装置（FIB）	2F 一般実験室	観察・計測・分析		技術代行専用	13,000	25,000	27,000	18,200	35,000	37,800	29,000	53,000	57,000	40,600	74,200	79,800
NPF035	イオンコーター（SEM付帯）（2F）	2F 一般実験室	観察・計測・分析	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF038	二次イオン質量分析装置（D-SIMS）	2F 一般実験室	観察・計測・分析		技術代行専用	9,100	19,100	22,100	12,700	24,600	28,100	25,000	45,000	51,000	35,000	59,500	65,100
NPF039	オゾンクリーナー（SIMS付帯）	2F 一般実験室	観察・計測・分析	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF041	ウェハー酸化炉	CR1 クリーンルーム	熱処理	4000	有償トレーニング	2,000	11,000	13,000	2,800	15,400	18,200	6,400	24,400	28,400	8,900	34,100	39,700
NPF044	マッフル炉	CR1 クリーンルーム	熱処理	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF045	触針式段差計	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF046	走査プローブ顕微鏡SPM_1[NanoscopeⅣ /Dimension3100]（注8）	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	6000	有償トレーニング	4,000	16,000	18,000	5,600	22,400	25,200	10,400	34,400	38,400	14,500	48,100	53,700
NPF047	走査プローブ顕微鏡SPM_2[SPM-9600/9700]（注8）	2F 一般実験室	観察・計測・分析	6000	有償トレーニング	4,000	16,000	18,000	5,600	22,400	25,200	10,400	34,400	38,400	14,500	48,100	53,700
NPF048	ナノサーチ顕微鏡SPM_3[SFT-3500]（注8）	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	6000	有償トレーニング	5,200	17,200	19,200	7,200	24,000	26,800	13,000	37,000	41,000	18,200	51,800	57,400
NPF049	ナノプローバー[N-6000SS]	2F 一般実験室	観察・計測・分析		技術代行専用	10,400	22,400	24,400	14,500	31,300	34,100	22,400	46,400	50,400	31,300	64,900	70,500
NPF050	四探針プローブ抵抗測定装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	0		500	9,500	11,500	700	13,300	16,100	4,000	22,000	26,000	5,600	30,800	36,400
NPF051	デバイスパラメータ評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	5000	有償トレーニング	2,600	12,600	15,600	3,600	17,600	21,800	6,400	26,400	32,400	8,900	36,900	45,300
NPF052	デバイス容量評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	5000	有償トレーニング	2,600	12,600	15,600	3,600	17,600	21,800	5,600	25,600	31,600	7,800	35,800	44,200
NPF053	ワイヤーボンダー（2F）	2F 一般実験室	観察・計測・分析	5000	有償トレーニング	2,600	12,600	15,600	3,600	17,600	21,800	6,400	26,400	32,400	8,900	36,900	45,300
NPF054	ダイシングソー	CR4 クリーンルーム	その他	6000	有償トレーニング	4,600	16,600	18,600	6,400	23,200	26,000	13,000	37,000	41,000	18,200	51,800	57,400
NPF055	スクライバー	CR4 クリーンルーム	その他	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF056	研磨機	CR1 クリーンルーム	その他	5000	有償トレーニング	1,300	11,300	14,300	1,800	15,800	20,000	4,000	24,000	30,000	5,600	33,600	42,000
NPF060	短波長レーザー顕微鏡[VK-9700]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	4000	有償トレーニング	2,600	11,600	13,600	3,600	16,200	19,000	7,200	25,200	29,200	10,000	35,200	40,800
NPF061	短波長レーザー顕微鏡[OLS-4100]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	4000	有償トレーニング	2,600	11,600	13,600	3,600	16,200	19,000	9,000	27,000	31,000	12,600	37,800	43,400
NPF063	分光エリプソメータ（注7）	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	4000	有償トレーニング	2,600	11,600	13,600	3,600	16,200	19,000	8,000	26,000	30,000	11,200	36,400	42,000
NPF064	解析用PC（分光エリプソメータ用）（注7）	2F データ解析室	観察・計測・分析	0		500	12,500	14,500	500	12,500	14,500	4,000	28,000	32,000	5,000	28,000	32,000
NPF065	顕微レーザーラマン分光装置（RAMAN）（注8）	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	5000	有償トレーニング	4,000	14,000	17,000	5,600	19,600	23,800	9,600	29,600	35,600	13,400	41,400	49,800
NPF066	顕微フーリエ変換赤外分光装置（FT-IR）（注8）	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	5000	有償トレーニング	2,600	12,600	15,600	3,600	17,600	21,800	6,400	26,400	32,400	8,900	36,900	45,300
NPF067	解析用PC（CADおよびSPM, FT-IR, RAMAN用）（注8）	2F データ解析室	観察・計測・分析	0		500	12,500	14,500	700	17,500	20,300	4,000	28,000	32,000	5,600	39,200	44,800
NPF068	磁気特性測定システム（MPMS）	2F 一般実験室	観察・計測・分析	5000	有償トレーニング	3,300	13,300	16,300	4,600	18,600	22,800	7,200	27,200	33,200	10,000	38,000	46,400
NPF070	X線回折装置（XRD）	2F 一般実験室	観察・計測・分析	5000	有償トレーニング	4,000	14,000	17,000	5,600	19,600	23,800	10,400	30,400	36,400	14,500	42,500	50,900
NPF072	微小部蛍光X線分析装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	5000	有償トレーニング	2,600	12,600	15,600	3,600	17,600	21,800	6,400	26,400	32,400	8,900	36,900	45,300
NPF073	解析用PC（X線用）	2F データ解析室	観察・計測・分析	0		500	12,500	14,500	500	12,500	14,500	4,000	28,000	32,000	5,000	28,000	32,000
NPF074	X線光電子分光分析装置（XPS）	2F 一般実験室	観察・計測・分析	5000	有償トレーニング	5,200	15,200	18,200	7,200	21,200	25,400	9,600	29,600	35,600	13,400	41,400	49,800
NPF075	解析用PC（XPS用）	2F データ解析室	観察・計測・分析	0		500	12,500	14,500	500	12,500	14,500	4,000	28,000	32,000	5,000	28,000	32,000
NPF081	プラズマCVD薄膜堆積装置（SiN）	CR5 クリーンルーム	成膜	5000	有償トレーニング	5,200	15,200	18,200	7,200	21,200	25,400	16,000	36,000	42,000	22,400	50,400	58,800
NPF082	化合物半導体エッチング装置（ICP-RIE）	CR5 クリーンルーム	エッチング		技術代行専用	11,700	21,700	24,700	16,300	30,300	34,500	29,000	49,000	55,000	40,600	68,600	77,000
NPF084	デジタルマイクロスコープ	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF085	物理特性測定装置（PPMS）	2F 一般実験室	観察・計測・分析	5000	有償トレーニング	6,500	16,500	19,500	9,100	23,100	27,300	16,000	36,000	42,000	22,400	50,400	58,800
NPF086	マニュアルウェハープローバー（2F）	2F 一般実験室	観察・計測・分析	5000	有償トレーニング	2,600	12,600	15,600	3,600	17,600	21,800	6,400	26,400	32,400	8,900	36,900	45,300
NPF089	赤外線ランプ加熱炉（RTA）	CR1 クリーンルーム	熱処理	5000	有償トレーニング	3,300	13,300	16,300	4,600	18,600	22,800	9,000	29,000	35,000	12,600	40,600	49,000
NPF091	自動塗布現像装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィー	5000	有償トレーニング	2,600	12,600	15,600	3,600	17,600	21,800	8,000	28,000	34,000	11,200	39,200	47,600
NPF092	高圧ジェットリフトオフ装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィー	5000	有償トレーニング	8,000	18,000	21,000	11,200	25,200	29,400	17,600	37,600	43,600	24,600	52,600	61,000
NPF093	高速電子ビーム描画装置（エリオニクス）	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー	5000	有償トレーニング	32,500	42,500	45,500	45,500	59,500	63,700	50,000	70,000	76,000	70,000	98,000	106,400
NPF094	解析用PC（CAD及び近接効果補正用）	2F データ解析室	リソグラフィー	6000	有償トレーニング	2,600	14,600	16,600	3,600	20,400	23,200	5,000	29,000	33,000	7,000	40,600	46,200
NPF095	RF-DCスパッタ成膜装置（芝浦）	CR1 クリーンルーム	成膜	5000	有償トレーニング	6,000	16,000	19,000	8,400	22,400	26,600	12,000	32,000	38,000	16,800	44,800	53,200
NPF096	単波長エリプソメータ	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	0		500	9,500	11,500	700	13,300	16,100	4,000	22,000	26,000	5,600	30,800	36,400
NPF098	ECRスパッタ成膜・ミリング装置	CR1 クリーンルーム	成膜	5000	有償トレーニング	4,000	14,000	17,000	5,600	19,600	23,800	9,600	29,600	35,600	13,400	41,400	49,800
NPF099	サムコ原子層堆積装置_2[AD-100LP]	CR5 クリーンルーム	成膜		技術代行専用	5,200	15,200	18,200	7,200	21,200	25,400	14,400	34,400	40,400	20,100	48,100	56,500
NPF100	解析用PC（CAD用）	2F データ解析室	その他	6000	有償トレーニング	500	12,500	14,500	700	17,500	20,300	4,000	28,000	32,000	5,600	39,200	44,800
NPF101	Si深掘エッチング装置[PlasmaPro_100]	CR5 クリーンルーム	エッチング	5000	有償トレーニング	10,400	20,400	23,400	14,500	28,500	32,700	29,000	49,000	55,000	40,600	68,600	77,000
NPF102	原子層堆積装置_3[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜		技術代行専用	8,000	18,000	21,000	11,200	25,200	29,400	19,200	39,200	45,200	26,800	54,800	63,200
NPF103	原子層堆積装置_3付帯XPS装置（アルバック・ファイ）	CR5 クリーンルーム	成膜	5000	有償トレーニング	5,200	15,200	18,200	7,200	21,200	25,400	9,600	29,600	35,600	13,400	41,400	49,800
NPF104	原子層堆積装置_4[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜		技術代行専用	8,000	18,000	21,000	11,200	25,200	29,400	19,200	39,200	45,200	26,800	54,800	63,200
NPF105	ピュアオゾン供給装置	CR5 クリーンルーム	成膜		技術代行専用	2,600	11,600	13,600	3,600	16,200	19,000	5,000	23,000	27,000	7,000	32,200	37,800
NPF106	小型自動現像装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィー	5000	有償トレーニング	1,300	11,300	14,300	1,800	15,800	20,000	4,000	24,000	30,000	5,600	33,600	42,000
NPF107	3次元電界放出形走査電子顕微鏡（エリオニクス）	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	6000	有償トレーニング	10,400	22,400	24,400	14,500	31,300	34,100	16,000	40,000	44,000	22,400	56,000	61,600
NPF108	イオンコーター（エリオニクス）	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF109	6インチ電子ビーム真空蒸着装置（アールデック）	CR1 クリーンルーム	成膜	5000	有償トレーニング	9,000	19,000	22,000	12,600	26,600	30,800	22,000	42,000	48,000	30,800	58,800	67,200
NPF110	レーザー描画装置[DWL66+]（注5）	CR2 イエロールーム	リソグラフィー	5000	有償トレーニング	13,000	23,000	26,000	18,200	32,200	36,400	36,000	56,000	62,000	50,400	78,400	86,800
NPF111	酸アルカリドラフトチャンバー_左（注6）	CR1 クリーンルーム	表面処理	0		500	12,500	14,500	500	12,500	14,500	6,200	30,200	34,200	7,700	30,200	34,200
NPF112	有機ドラフトチャンバー_左（EB）（注6）	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF113	スピンコーター（EB）	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF114	平行平板型プラズマアッシャー	CR5 クリーンルーム	表面処理	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF115	大面積電子ビーム描画装置[BODEN50]	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー	5000	有償トレーニング	48,800	58,800	61,800	68,300	148,400	151,900	97,500	117,500	123,500	136,500	297,500	303,100
NPF116	EB用自動現像装置（カナメックス）	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー	5000	有償トレーニング	1,300	11,300	14,300	1,800	15,800	20,000	4,000	24,000	30,000	5,600	33,600	42,000
NPF117	多機能型薄膜X線回折装置（XRD）	2F 一般実験室	観察・計測・分析	5000	有償トレーニング	5,000	15,000	18,000	7,000	21,000	25,200	11,400	31,400	37,400	15,900	43,900	52,300
NPF118	多機能型光電子分光分析装置（XPS）	2F 一般実験室	観察・計測・分析	5000	有償トレーニング	6,200	16,200	19,200	8,600	22,600	26,800	10,600	30,600	36,600	14,800	42,800	51,200
NPF119	マスクレス露光装置［MLA150］（注5）	CR2 クリーンルーム	リソグラフィー	5000	有償トレーニング	12,400	22,400	25,400	17,300	31,300	35,500	39,600	59,600	65,600	55,400	83,400	91,800
NPF120	マスクレス露光装置（DL-2500iA1）（注6）	CR2 クリーンルーム	リソグラフィー	5000	有償トレーニング	12,400	22,400	25,400	17,300	31,300	35,500	39,600	59,600	65,600	55,400	83,400	91,800
NPF121	電界放出形走査電子顕微鏡（JSM7400F）	2F 一般実験室	観察・計測・分析	6000	有償トレーニング	10,400	22,400	24,400	14,500	31,300	34,100	16,000	40,000	44,000	22,400	56,000	61,600
NPF122	イオンコーター3	2F 一般実験室	観察・計測・分析	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF123	白色干渉計搭載レーザー顕微鏡	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	4000	有償トレーニング	2,600	11,600	13,600	3,600	16,200	19,000	9,000	27,000	31,000	12,600	37,800	43,400

【NPF122】と【NPF123】の2つの装置を追加しました。それ以外の装置に関して変更点はありません。
3つの支援形態は約款第6条の各項と次の式の対応関係があります。
機器利用=共用施設等使用料
技術補助=共用施設等使用料＋運転費＋技術指導費
技術代行=共用施設等使用料＋運転費＋技術代行費
※装置番号：NPFで装置管理のために使用している番号、NPF###で表されます。尚、ARIM事業では、AT-###の装置番号が対応します。
※消費税等により生じた小数点以下の端数については切捨てで処理致します。
※この単価表に記載した金額に消費税等は含まれておりません。
※ユーザーのご所属により、課金額に下記の係数が掛かります。
　その他、支援形態や利用報告書提出の可否によって課金額が変わることがございます。詳しくはNPF事務局（tia-npf-ml@aist.go.jp）にお問い合わせください。
　中小企業(中小企業支援法第2条参照) 0.5 （中小企業割引）
　大学及び公的研究機関 0.5（アカデミック割引、産総研所属の利用者はここに該当します。）
　上記に該当しない場合は 1
（注1）最初のご利用前には、トレーニング受講が必要です。「有償トレーニング」と記載された装置につきましては、有償となります。「技術代行専用」と記載された装置につきましては、原則技術代行のみでのご利用となります。
（注2）有償トレーニングの料金は、対象装置の有償トレーニングカテゴリーによって異なります。尚、額は、1回あたりのものとなります。ご自身の試料を用いたトレーニング、2回目以降のトレーニングを希望されるときは、技術補助を申請して下さい。
（注3）NPFのスタッフが他の施設（産総研の他の共用施設及びNIMS、筑波大学等他機関の共用施設）の装置の技術代行を行う場合は、当該施設の装置の機器利用料に加え一律12,000円（利用報告書提出）、24,000円（利用報告書不提出）を加算致します。
（注4）利用報告書非提出でご利用の場合は、ここに記載された金額の他に15%の「運営管理費」が加算されます。ご了承ください。
（注5）NPF012及びNPF013ドラフトチャンバはCR2内露光装置（NPF006、110、119、120）の塗布・現像場所も兼ねております。両装置のトレーニングは同時に行います。トレーニング申請の際は、NPF012を申請してください。
（注6）NPF014,NPF015,NPF111,NPF112のドラフトチャンバー4台のトレーニングは同時に行います。トレーニング申請の際は、NPF014を申請してください。
（注7）NPF064はNPF063のデータ解析用PCです。NPF063と同時にトレーニングします。
（注8）NPF067は、NPF046,047,048, 065, 066の共用のデータ解析用PCです。NPF046,047,048, 065, 066のいずれかをトレーニングを申請されると、同時にトレーニングします。